66000

垂直磁化膜の磁気コンプトンプロファイルの異方性

櫻井 浩 群馬大学工学研究科生産システム工学専攻 〒376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1

要 旨 垂直磁化膜の磁気コンプトン散乱を測定し、スピンに依存した運動量分布の異方性の観測に成功した。これ らの実験から、貴金属/3d 遷移金属で構成される金属人工格子の垂直磁気異方性は 3d 遷移金属の 3d 電子の異方性の寄 与に起因することがわかった。しかしながら、TbFeCo アモルファス合金は等方的な電子構造を示しており、TbFeCo ア モルファス合金の垂直磁気異方性は磁気構造を間接的に反映することがわかった。

1. はじめに

これまで多くの磁気記録に利用されてきた水平磁気記録 方式は100 Gbit/inch² 程度が限界とされている。そのため、 2004年から2005年にかけて垂直磁気記録方式の製品が次 々と発表された。今後磁気記録の主流になると予想され、 世界の市場規模は2010年に3兆円から6兆円程度と予想 されている(日本のシェアーは30%程度)¹⁾。

これまで貴金属/遷移金属人工格子薄膜(Pd/Co, Pt/ Co, Pt/Feなど)²⁻⁸⁾, TbFeCoアモルファス薄膜⁹⁻¹⁰⁾をは じめ,多くの磁性薄膜が垂直磁気記録材料として報告され ている。しかし,実用的視点からの材料開発の研究が先行 する一方,垂直磁気異方性の起源については今だ明確でな いことが多い。そこで,本研究では,波動関数の異方性に 着目し,磁気異方性との関連を調べることを目的とした。

2. 磁気コンプトンプロファイル

コンプトン散乱は光の粒子性を示す実験として,多くの 量子力学の教科書に説明されている¹¹⁾。さらに,固体物 理学の教科書には,コンプトン散乱の実験は電子運動量分 布またはフェルミ面の測定手法として紹介されてい る¹²⁾。一方,円偏光したy線を用いて強磁性体のコンプ トン散乱を測定すると磁気的な効果があることをN. SakaiとK. Ônoが1976年に実験的に報告し¹³⁾,スピンに 依存した運動量分布(majority spin とminority spin の運 動量分布の差)を測定している。スピンに依存したコンプ トン効果を磁気コンプトン効果とよび,磁気コンプトン効 果の測定から得られるスピンに依存した運動量分布を磁気 コンプトンプロファイル(magnetic Compton profile: MCP) とよぶ。1980年代になって放射光施設が発展して高強度 の円偏光X線が得られるようになり,金属,合金の磁気 コンプトンプロファイルの測定の報告が増えている¹⁴⁾。

磁気コンプトン効果は上述のようなスピンに依存した現

象であるが、その散乱断面積の導出は相対論的量子電磁学の計算になり、その計算過程からは現象の物理的内容が理解しにくい。X線のエネルギーが電子の静止質量エネルギーに比べて小さい場合は、非相対論的なハミルトニアンに相対論的補正項を追加して摂動計算によって散乱断面積を求めるほうがなじみやすい。そこで、電磁場のもとにある電子のハミルトニアンをm⁻²の項まで考慮してかいてみると¹⁵⁾

$$H = \sum_{j} \frac{1}{2m} \left(\mathbf{p}_{j} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}_{j}) \right)^{2} + \sum_{j} V(r_{ij}) - \frac{e\hbar}{mc} \sum_{j} \mathbf{s}_{j} \cdot \nabla$$
$$\times \mathbf{A}(\mathbf{r}_{j}) - \frac{e\hbar}{2(mc)^{2}} \sum_{j} \mathbf{s}_{j} \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_{j}) \times \left(\mathbf{p}_{j} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}_{j}) \right)$$
(1)

と表される。ここで, m, e は電子の質量と電荷, p はその 運動量, s は電子スピン, E は電磁場の電気ベクトル, V, A は電磁場のスカラーポテンシャルとベクトルポテンシ ャル, c は光速である。第3項,第4項がディラック方程 式に基づく補正項である。第3項,第4項からスピンに 依存する散乱があることがわかる。インパルス近似を考慮 して散乱断面積を計算する。この過程は複雑であるので結 果だけ記述すると^{14,16},

$$\frac{d^{2}\sigma}{d\Omega d\omega_{2}} = r_{0}^{2} \frac{\omega_{2}}{\omega_{1}} \left((\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{1} \cdot \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{2}^{*})^{2} \iint (\boldsymbol{\rho}_{maj} + \boldsymbol{\rho}_{\min}) d\boldsymbol{p}_{x} d\boldsymbol{p}_{y} + 2 \frac{\hbar \omega_{1}}{mc^{2}} \left(\operatorname{Im} \left[(\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{1} \cdot \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_{2}^{*})^{*} B_{z} \right] \right) \iint (\boldsymbol{\rho}_{maj} - \boldsymbol{\rho}_{\min}) d\boldsymbol{p}_{x} d\boldsymbol{p}_{y} \right)$$

$$(2)$$

となる。ただし,

$$\mathbf{B} = (\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_2^* \times \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_1) + (\hat{\mathbf{k}}_2 \times \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_2^*) (\hat{\mathbf{k}}_2 \cdot \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_1) - (\hat{\mathbf{k}}_1 \times \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_1^*) (\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_2^*) - (\hat{\mathbf{k}}_2 \times \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_2^*) \times (\hat{\mathbf{k}}_1 \times \hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_1)$$
(3)

である。ここで、 $\hbar\omega_1$, $\hat{\mathbf{k}}_1$, $\hat{\mathbf{\epsilon}}_1$ はそれぞれ入射 X 線のエネ ルギー、入射 X 線方向の単位ベクトル、入射 X 線の電場 ベクトルを表し、 $\hbar\omega_2$, $\hat{\mathbf{k}}_2$, $\hat{\mathbf{\epsilon}}_2$ は散乱 X 線のそれらを表 す。また、 r_0 は古典的電子半径を表す。ここで、 $\rho_{maj}(\mathbf{p})$ ($\rho_{min}(\mathbf{p})$) は majority spin (minority spin)の運動量密度 である。(2)式の第2項にあらわれる

$$J_{mag}(p_z) = \iint (\rho_{maj} - \rho_{min}) dp_x dp_y$$
(4)

が磁気コンプトンプロファイルである。(2)式の第2項の 電場ベクトルに虚数を含んでいれば、すなわち円偏光であ れば磁気コンプトンプロファイルが測定できることがわか る。さらに系が一電子状態の波動関数 $\Psi_{\sigma i}(\mathbf{r})$ ($\sigma = maj$ (min) は majority spin (minority spin)を表す。)で記述さ れる独立粒子で構成されていると考えると、majority spin の (minority spin) 運動量密度 $\rho_{maj}(\mathbf{p})$ ($\rho_{min}(\mathbf{p})$) は次の ように表すことができる^{14,16,17}。

$$\rho_{\sigma}(\mathbf{p}) = \sum_{i}^{\infty} |\chi_{\sigma i}(\mathbf{p})|^{2}$$
(5)

$$\boldsymbol{\chi}_{\sigma i}(\mathbf{p}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\right)^3 \int \boldsymbol{\psi}_{\sigma i}(\mathbf{r}) \, \exp\left(-\frac{i\mathbf{p}\mathbf{r}}{\hbar}\right) \mathrm{d}\mathbf{r} \qquad (6)$$

以上から,(5)式の運動量密度は一電子状態の和として 表すことができ,したがって,その2重積分である(4)式 の磁気コンプトンプロファイルも一電子状態の和として表 すことができる。詳細は解説を参照されたい^{14,18)}。

以上から磁気コンプトンプロファイルの測定は2つの 特徴を有する。

- ① (4)式で表されるように、磁気コンプトンプロファイルは2重積分であるため、あるp₂におけるスピンに依存した運動量密度の「断面積」を観測する。p₂方向を変えて測定すれば、医学における tomographyと同様、スピンに依存した運動量密度の「形状」が観測できる。これは(5)、(6)式で表されるように運動量空間の波動関数の形状を反映している。
- ② 磁気コンプトンプロファイルは一電子状態の和である。したがって、後で述べるように、一軸性結晶場における3d電子の各状態のように特徴的な運動量分布を有する場合は、あらかじめモデル計算によって理論的運動量分布を求めておけば、fittingによる解析から各電子状態を分離することができる。同様に希土類金属における4f電子と3d遷移金属における3d電子の運動量分布のように高運動量成分の形状が異なっている場合も、あらかじめモデル計算によって理論的運動量分布を求めておけばfittingによる解析から元素選択的なスピン磁気モーメントを求めることができる。原子状態の各元素、各軌道のモデル計算はデータテー

ブル¹⁹⁾が作成されている。

以上から磁気コンプトンプロファイルは磁性薄膜の波動 関数の異方性の観測や元素選択的なスピン磁気モーメント の観測に有効であることがわかるであろう。しかし,これ まで磁気コンプトン散乱の実験では60 keV から180 keV の高エネルギーX線を利用するため、薄膜の測定は困難 とみなされてきた。しかし、最近我々は、わずか1 μ mの 厚さである Pd/Co人工格子(実際には4回折りたたんで 有効厚さを16 μ m とした)の磁気コンプトンプロファイル の異方性測定が可能であることを実証した^{20,21)}。そこで、 以下いくつかの垂直磁気異方性を有する磁性薄膜の磁気コ ンプトンプロファイルの測定例を報告したい。

3. 磁気コンプトンプロファイルの測定

磁気コンプトンプロファイルの測定システムは、レイア ウトが簡単であるということが大きな特徴である。基本的 には磁場発生装置とコンプトン散乱X線スペクトルを測 定できる検出器があればよい。回折線を測定するわけでは ないので、試料、散乱ベクトル、磁場の3者の関係は大 事であるが、厳密にあわせる必要はない。結晶試料でもア モルファス試料でも測定可能である。高エネルギーX線 を利用するので表面の寄与は無視することができる。ただ し,前述したように,入射X線は単色でかつ円偏光であ る必要がある。そのため,放射光施設の利用が必要であ る。そこで、実験は SPring-8-BL08W および KEK-PF-ARNE1A1 で行った。施設としての性能はどちらのビー ムラインでも十分測定可能である。ユーザーインターフ ェースを考慮したユーティリティー、ビームラインのスペ ックなどで比較すると、例えば SPring-8-BL08W では3 days 程度で行っている実験を KEK-PF-ARNE1A1 では 10 days 程度で行っている。今後のユーザーの広がりを前 提に SPring-8-BL08W のスペック²²⁾を中心に説明する。

実験配置の概略を Fig. 1 に示す。モノクロメーター Si (620)で174 keV に単色化された入射 X 線 (入射 X 線の 円偏光度0.76)はスリットで整形され,入射 X 線強度を 測定する I₀モニターを通り,10素子の Ge 半導体検出器 の中心の穴を通り試料で散乱する。散乱角178°でコンプ トン散乱した X 線は10素子の Ge 半導体検出器によって 検出され,エネルギースペクトルが測定される。分解能は



Fig. 1 Schematic diagrams of the experimental set-up.

Ge 半導体検出器で決まり0.43 a.u. 程度である。試料は超 伝導磁石中にあり、+2.5 T あるいは-2.5 T の磁場がか けられている。また、散乱ベクトル(p_z 方向)と磁場の 方向は平行である。

+2.5 T の場合と-2.5 T の場合のコンプトン散乱 X 線 のスペクトルを測定し,差を求めれば磁気コンプトン散乱 に起因する散乱 X 線のスペクトルが得られる。このスペ クトルを半導体検出器の検出効率のエネルギー依存性,試 料の吸収補正,(磁気)コンプトン散乱の散乱断面積補正, エネルギースペクトルの電子の運動量への換算などのデー タ補正を行うと(4)式で表される磁気コンプトンプロファ イルが得られる。

散乱ベクトル (p_z 方向) と人工格子の積層方向が平行 すなわち膜面垂直な方向である場合を「out-of-plane」の 測定と名づける。一方,散乱ベクトル (p_z 方向)が膜面 内の方向である場合を「in-plane」の測定と名づける。 「out-of-plane」の測定と「in-plane」の測定の磁気コンプ トンプロファイルの差から異方性を求める。測定温度はす べて室温であった。

薄膜のコンプトンプロファイル測定の場合,基板からの 散乱のため S/N が悪くなると予想される。そこで、十分 な機械的強度があり、電子濃度が小さい軽元素中心ででき るだけ薄くかつ入手しやすい基板を検討した。その結果 4 μ m 程度の厚さの PET フィルム(ポリエチレンテレフタ レート: (-OCH₂CH₂OCOC₆H₄CO-)_n)が基板として適当 であると考えた。また、後述するように、12 μ m の Al フ rイル基板でも測定が可能であることがわかった。

薄膜の成膜には高周波スパッタ法を用いた。人工格子は 厚さ4μmのPETフィルム上に作製した。TbFeCoアモ ルファス薄膜は厚さ12μm Alフォイル基板上に作製した。 X線回折によって人工格子の構造および人工周期を確認 した。人工周期は中角散乱のサテライトピークを利用して 求めた。

磁気コンプトン散乱の測定に際しては、散乱体の体積を 稼ぐために薄膜を4回折りたたんだ。その結果、1 μ mの 薄膜の有効厚さは16 μ mとなり、4 μ mのPET 基板の有 効厚さは64 μ mとなった。

4. 薄膜の測定法の検討²⁰⁾

Fig. 2(a)は PET フィルム基板上に成膜した厚さ1µm のFe 薄膜のコンプトンプロファイルを示す。103 keV 付 近のピークがコンプトン散乱した X 線のスペクトルであ る。電子の運動量分布を反映して広がりをもっている。 103 keV は静止した電子からのコンプトン散乱 X 線に相 当するエネルギーである。Fe の磁気コンプトン効果は通 常のコンプトン効果に対して 2%程度とわずかである。 しかし、スピンを反転させながらコンプトン散乱 X 線の スペクトルを測定し、差し引きすれば磁気コンプトン効果



Fig. 2 (a) an energy spectrum of Compton scattered X-rays from an Fe 1 μ m film on a polyethylene terephthalate substrate. (b) an energy spectrum of magnetic Compton scattered Xrays from the Fe 1 μ m film.

のみが抽出される。基板は非磁性であるので、基板からの コンプトン散乱 X 線も差し引きされる。Fe 1 µm 薄膜か らの磁気コンプトン散乱 X 線のスペクトルを Fig. 2(b) に 示す。

Fig. 2(b)に示した磁気コンプトン散乱 X 線のスペクトル のデータを前述したようにデータ処理すると磁気コンプト ンプロファイルが得られる。**Fig. 3**に10 μ m の Fe フォイ ル (bulk Fe)の磁気コンプトンプロファイルと PET 基 板上に成膜した 1 μ m の Fe 薄膜の磁気コンプトンプロフ ァイルを示す。両者は統計精度範囲内で一致しており、基 板上の厚さ 1 μ m 薄膜でも十分測定できることがわかった。

Table Iは SPring-8-BL08W で測定した場合のコンプト ンピークエネルギー ω_c における計数率 $C(\omega_c)$, マグネテ ィックエフェクト $Me(\omega_c)$, Signal to Noise Ratio (S/N) = 20に必要な測定時間 t(hr) を示す。ただし,

$$C(\omega_c) = (I_+(\omega_c) + I_-(\omega_c))/t$$

$$Me(\omega_c) = \frac{I_+(\omega_c) - I_-(\omega_c)}{I_+(\omega_c) + I_-(\omega_c)}$$

$$S/N = \frac{(I_+(\omega_c) - I_-(\omega_c))}{(I_+(\omega_c) + I_-(\omega_c))^{1/2}}$$
(7)

である。ここで、 $I_+(I_-)$ は散乱ベクトルと磁場が平行 (反平行)な場合のコンプトン散乱 X 線強度を表す。厚さ 10 μ m の Fe フォイル, PET 基板上に成膜した 1 μ m の Fe 薄膜および Pd/Co 人工格子薄膜について、 $C(\omega_c)$, *Me* (ω_c), *t* を検討した。Pd/Co 人工格子薄膜については inplane 測定および out-of-plane 測定で検討した。3d 遷移金 属合金の場合、**Fig. 3**に示すように、運動量 $p_z = 0$ 付近に くぼみがある。このくぼみは 3d-4s, p 軌道混成に起因し

		=			
Sample	effctive thickness/µm	applied field	Count rate, $C(\omega_c)/(\text{count/hr})$	Magnetic effect, $Me(\omega_c)$ (%)	Estimated measuring hours, t/hr
Fe plate 10 µm	Fe 10 µm	in-plane	$5.7 imes 10^{5}$	2.2	1.5
Fe film 1 μm	Fe 16 μm PET 64 μm	in-plane	1.0×10^{7}	0.65	1.0
Co/Pd 1 µm	Co/Pd 16 μm PET 64 μm	in-plane	1.1×10^{7}	0.26	5.4
Co/Pd 1 µm	Co/Pd 16 μm PET 64 μm	out of plane	$5.5 imes 10^{5}$	0.23	137

Table I Effective thickness, count rates $(C(\omega_c))$, estimated measuring hours (t) for S/N=20, magnetic effects $(Me(\omega_c))$ at the Compton peak energy (103 keV as shown Fig. 2(a)). Film samples are folded to 4 times to increase the effective thickness



Fig. 3 A magnetic Compton profiles of an Fe 1 μ m film and on a polyethylene terephthalate substrate and that of Fe 10 μ m foil.

ており、3d 電子のスピンと4s,p電子のスピンが反並行 に結合していることを示す^{23,24}。この構造は磁気コンプト ンプロファイルのピークに対して10%程度であるので、 少なくとも5%よりよい統計精度が必要であろう。した がって、S/Nは20以上が好ましい。Table Iをみると人工 格子の場合でも最大で5日測定すればS/Nが20以上とな り、運動量密度の異方性の測定が可能であることがわか る。その他の系を測定する場合には、薄膜の磁化の大き さ、基板と薄膜の厚さの比でも測定にかかる時間は変わる し、観測したい内容によってはS/Nは20以上である必要 はない。最近の我々の実験では、多くても2日程度で結 果がでることが多い。

5. 原子の 3d 電子の波動関数を用いた異方性 のモデル計算

磁気コンプトンプロファイルの異方性の検討に当たり, モデル計算を検討した。人工格子は積層方向(膜面垂直 (out-of-plane)方向)をz軸とする一軸性結晶場(円筒対 称)にあると考えられる。この場合 3d 電子の状態はmを 磁気量子数とすると $|m|=0, 1, 2 \circ 3$ つの状態に分裂す る²⁵⁻²⁸⁾。**Fig. 4** は一軸性結晶場によって $|m|=0, 1, 2 \circ 3$ つの状態に分裂した各場合の電子の軌道の形, すなわち波



Fig. 4 Schematic diagram of electron densities with |m| = 0, |m| = 1 and |m| = 2 states (m: magnetic quantum numbers) of 3d states.

動関数の形を示す。|m|=0では原点付近に構造がある。 |m|=1では原点付近に波動関数の節が存在し、波動関数 が 0 となる。|m|=2では「赤血球」のような形をしてい る。

今,実空間における原子の1電子波動関数 $\Psi(\mathbf{r})$,(6) 式から求められる運動量空間の波動関数を $\chi(\mathbf{r})$ とすれば

$$\psi(\mathbf{r}) = f_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$
(8)

$$\chi(\mathbf{r}) = u_{nl}(p) Y_{lm}(\theta_p, \varphi_p)$$
(9)

と表される¹⁴⁾。ここで, $f_{nl}(r)$ は実空間における波動関数 の動径部分, $u_{nl}(p)$ は運動量空間における波動関数の動径 部分, Y_{lm} は球面調和関数で実空間および運動量空間にお ける波動関数の角度部分を表す。(8), (9)から実空間の 波動関数と運動量空間の波動関数の角度部分は同一である ので,波動関数の「形」(対称性)は実空間と運動量空間 で変わらないことがわかる。したがって,**Fig.4**に描かれ ている 3d 電子の各磁気量子数 |m| = 0, 1, 2に対応する波 動関数の「形」は、実空間においても運動量空間において も同様であると考えられる。コンプトンプロファイルは (4)式で表されるように、運動量密度(運動量空間の波動 関数の絶対値の自乗)の二重積分である。したがって, 3d 電子の各磁気量子数 |m| = 0, 1, 2に対応するコンプト ンプロファイルは、直感的には**Fig.4**の波動関数の「形」 の断面積と考えてよい。

例えば p_z 軸を Fig. 4 の z 軸にとってみる (out-of-plane)。 波動関数の z 軸方向の広がりは |m| = 0, 1, 2の順に大き くなるので、コンプトンプロファイルの幅も |m| = 0, 1, 2の順に大きいであろう。また、|m| = 0の場合、 $p_z = 0$ 付 近にコンプトンプロファイル構造があると期待される。ま た、|m| = 1の場合、 $p_z = 0$ で波動関数の節があるため、 コンプトンプロファイルは 0 となる。一方、|m| = 2の場 合、 $p_z = 0$ をピークとするドームのようになるであろう。 Fig. 4の x 軸(または y 軸)を p_z 軸にとってみる(inplane)。この場合、形状の特徴を直感的に予測するのは難 しいが、波動関数の x 軸(または y 軸)方向の広がりは |m| = 2, 1, 0の順に大きくなるので、コンプトンプロファ イルの幅も |m| = 2, 1, 0の順に大きいであろう。

上述のような特徴を確かめてみるために, Hatree-Fock 近似による atomic な状態を仮定して、3d 電子の |m|=0, 1,2の各磁気量子数に対応する運動量密度を求め、数値計 算で二重積分を行い、コンプトンプロファイルを計算し た^{19,20)}。結果を **Fig. 5** に示す。ここで, out-of-plane は一 軸結晶場の軸方向(z軸)をpz軸とした場合であり, inplane は一軸結晶場の軸方向と垂直方向(x軸またはy軸) を p_2 軸とした場合である。out-of-plane の場合はコンプト ンプロファイルの幅も | m | = 0, 1, 2の順に大きい。ま た, |m| = 0の場合, $p_2 = 0$ 付近にコンプトンプロファイ ル構造がある。|m|=1の場合, $p_z=0$ で波動関数の節が あるため、コンプトンプロファイルは0となる。一方, |m|=2の場合, $p_z=0$ をピークとするドームのようにな る。in-plane 場合, コンプトンプロファイルの幅は |m| =2, 1, 0 の順に大きい。Fig. 5 に out-of-plane と in-plane の 場合の差(異方性)を示す。磁気量子数 |m| によって, コンプトンプロファイルの異方性に特徴があることがわか る。

以上から、磁気量子数 |m| に依存した特徴的な波動関数の形状がコンプトンプロファイルの形状および異方性に反映していることがわかる。さらに、コンプトンプロファイルの測定を行う場合、out-of-planeの場合のほうが inplane の場合より磁気量子数 |m| に依存した波動関数の形状を観測しやすいことがわかる。



Fig. 5 Model Compton profiles with the magnetic quantum numbers of |m| = 0, 1, and 2.

6. Pd/Co人工格子の磁気コンプトンプロフ ァイル²¹⁾

Pd/Co人工格子は Co が数原子層以下の場合, Pd 層が 厚くなるにつれて垂直磁気異方性を示すことが知られてい る^{6,7)}。例えば本研究で用いた Pd(x nm)/Co(0.8 nm)人工 格子 (x=0.8, 1.6, 4.0)の垂直磁気異方性エネルギーを測 定するとx=0.8の時-1.30 Merg/cm³, x=1.6の時1.45 Merg/cm³, x=4.0の時2.89 Merg/cm³ となる。垂直磁気 異方性エネルギーが正の時垂直磁化膜であるので, x=1.6 と4.0の場合が垂直磁化膜になる。Fig. 6 にこれらの人工格 子の磁気コンプトンプロファイルとその異方性を示す。 Pd 層の厚さに依存して,磁気コンプトンプロファイルの 形状が変わる。Pd 厚さ依存性は in-plane より out-ofplane のほうが顕著である。また,異方性も Pd 層の厚さ に依存している。

Pd/Co 人工格子は Co のみならず Pd4d 電子も磁気モー メントを有することが知られている²⁹⁾。したがって,異 方性の起源は Co3d 電子または Pd4d 電子と考えられる。 そこで Fig. 5 と同様なモデル計算を行い,Pd4d の異方性 の寄与を検討した結果,Pd4d の異方性の寄与は無視でき ることがわかった²¹⁾。

以上から、Co3dの異方性の寄与のみを考慮して磁気コ ンプトンプロファイルの異方性を再現するように Fig. 5 に 示したモデル計算のプロファイルを fitting 関数として磁 気量子数 |m| = 0, 1, 2の寄与を分離した。結果を Table II に示す。垂直磁気異方性エネルギーが負である x = 0.8の 場合は磁気量子数 |m| = 0, 1, 2の分布が20%, 40%, 40% に近く,波動関数は球対称に近い。一方,弱い垂直磁気異 方性を有する x = 1.6の場合は磁気量子数 |m| = 1の割合が 多い。強い磁気異方性を示す x = 4.0の場合は磁気量子数

Table IIPopulation of the each magnetic quantum number |m| =0, 1, and 2 in Pd/Co multilayers

	m =0	m = 1	<i>m</i> =2
Pd(0.8 nm)/Co(0.8 nm)	19%	40%	41%
$Pd\left(1.6\ nm\right)/Co\left(0.8\ nm\right)$	10%	60%	30%
Pd(4.0 nm)/Co(0.8 nm)	29%	21%	50%



Fig. 6 Magnetic Compton profiles of Pd/Co multilayers and these anisotropies. Dots denote the experimental data and solid lines denote fitling results.

|m|=2の割合が多い。これまで、X 線磁気円二色性の実験から、Pd/Co人工格子の垂直磁気異方性の起源は、 Co3d 電子の軌道磁気モーメントに異方性に起因することが指摘されている³⁰⁾。さらに、軌道磁気モーメントの異方性の起源は Co3d 電子の磁気量子数 |m|=2に寄与であることが理論的に指摘されていた²⁶⁻²⁸⁾。強い磁気異方性を示す x=4.0の場合はこれまでの報告と同様、|m|=2に寄与が大きい。一方、弱い垂直磁気異方性を有するx=1.6の場合は、|m|=1の寄与が大きいことがわかった。以上から垂直磁気異方性では |m|=2のみならず |m|=1の寄与もあることがわかった。

Pd/Fe 人工格子の磁気コンプトンプロフ ァイル³¹⁾

Pd/Fe 人工格子は Fe 層の厚さ2 nm 以下で fcc 相を示 し, Fe の磁気モーメントが2.7 μ_B に増大することが知ら れている³²⁾。また,垂直磁気異方性は有さず,磁気異方 性の小さい FePd 合金は高磁率材料として知られてい る^{33,34)}。Fig. 7 に Pd (1.6 nm)/Fe (x nm)人工格子 (x = 0.8, 1.6, 4.0)の磁気コンプトンプロファイルおよびその 異方性を示す。Pd/Co人工格子に比べて異方性が20%以 下であり,波動関数の異方性が小さい。3d 遷移金属の Co を Fe で入れ替えると波動関数に異方性がなくなり,同時



Fig. 7 Magnetic Compton profiles of Pd/Fe multilayers and these anisotropies. Dots denote the experimental data and solid lines denote fitling results.

に垂直磁気異方性が消失することから、垂直磁気異方性に は3d電子の寄与が重要であることがわかる。また、磁気 異方性が小さい(磁歪が小さい)材料が高透磁率をしめす ことから、Pd/Fe人工格子の場合は、波動関数の異方性 が小さいため磁気異方性も小さく、そのため高透磁率示す ことがわかった。Kyunoらによるバンド計算²⁶⁻²⁸⁾による と、Pd/Co人工格子、Pd/Fe人工格子いずれの場合も majority スピンはFermiレベル以下であるが、Pd/Co人 工格子の場合は minority スピンの状態密度のピークが Fermiレベルにあるため磁気異方性が大きく、Pd/Fe人 工格子の場合は minority スピンの状態密度の裾にFermi レベルにあるため磁気異方性が小さくなることが指摘され ている。

8. Fe 層の寄与と Pt 層の寄与の分離—Fe/Pt 人工格子の磁気コンプトンプロファイ ル³⁵⁾

Pt/Fe人工格子は Fe が数原子層以下で fcc 構造を有し 垂直磁気異方性を発現する⁸⁾。さらに,低温では垂直磁気 異方性から面内磁気異方性になることが知られている⁸⁾。 Pt(2.0 nm)/Fe(x nm)(x=0.9, 2.3)における磁気コンプ トンプロファイルとその異方性を Fig. 8 に示す。磁気コン プトンプロファイルの形状とその異方性は Fe 層の厚さに 依存して変わる。さらに,飽和磁化と Fe 層の体積比が線 形であることから,磁気コンプトンプロファイルの面積を 磁化測定の値で規格化し,Fe100%または Pt100%の場合 に外そうして Fe 層の磁気コンプトンプロファイルの寄与 と Pt 層の磁気コンプトンプロファイルの寄与を分離した。 Pt 層の磁気コンプトンプロファイルと Fe 層の磁気コンプ トンプロファイルを Fig. 9 に示す。異方性は Pt 層より Fe 層で顕著である。Fe 層のプロファイルの異方性は,垂直



Fig. 8 Magnetic Compton profiles of Pt/Fe multilayers and these anisotropies.



Fig. 9 Magnetic Compton profiles of fcc Pt and fcc Fe in Pt/Fe multilayers. Solid lines denote a band calculation of fcc Fe.

磁気異方性を有する Pd(4.0 nm)/Co(0.8 nm)人工格子の 特徴と類似しており, Fe3d 電子の磁気量子数 |m|=2の 寄与に起因すると考えられる。以上から, Fe/Pt 人工格子 の磁気異方性は Fe 層の磁気異方性に起因することがわか った。

9. TbFeCo アモルファス合金の磁気コンプト ンプロファイル^{36,37)}

TbFeCoアモルファス合金は既に光磁気記録媒体として 広く普及しているが,近年熱アシスト型次世代垂直磁気記 録メディアとしての研究が進められている^{9,10)}。一方,同 じ組成でも製膜時のスパッタリングガス圧力を制御するこ とで垂直磁気異方性と面内磁気異方性を制御できる³⁸⁾。 本研究では Ar 5 mTorr スパッタリングすると垂直磁気異



Fig. 10 Magnetic Compton profiles of TbFeCo films with perpendicular magnetic anisotropy (PMA) and isotropic magnetization (IM), and these anisotropies.

方性を有し、組成は Tb₂₇Fe₆₅Co₈ であった。Ar 30 mTorr でスパッタリングすると等方的磁化を有し、組成は Tb₂₈ Fe₆₁Co₁₁であった。しかし、ほぼ同じ組成なのに磁気異 方性が異なるのはなぜか、そもそも均一なアモルファスの はずなのになぜ垂直磁気異方性を有するのかなど研究が進 められている³⁹⁻⁴¹⁾。Fig. 10 は前述のほぼ同じ組成で異なる スパッタリングガス圧で製膜した試料の磁気コンプトンプ ロファイルとその異方性である(磁気コンプトンプロファ イル測定は室温)。垂直磁化膜と等方的磁化膜ではプロフ ァイルの形状が著しく異なっていることがわかる。しか し、垂直磁化膜と等方的磁化膜の磁気コンプトンプロファ イルの異方性はどちらも小さい。これらのことから、 TbFeCo アモルファス合金では垂直磁気異方性に対する波 動関数の異方性の寄与が小さく、垂直磁気異方性の起源は 直接的には電子構造ではないことがわかった。数%程度の 原子の規則配列が垂直磁気異方性に寄与するとの報告⁴²⁾ もあり、わずかな結晶場の異方性を観測できなかった可能 性もある。今後検討を続ける必要がある。

さらに、磁気コンプトンプロファイルと磁化測定を組み 合わせて、Feの磁気モーメントとTbの磁気モーメント の寄与を分離した。TbFeCoアモルファス合金はスペリ磁 性^{39-41,43)}を有するとする報告があるので、Tb4fが4f⁸の 電子配置にあるとして磁気モーメントを $9\mu_B^{41}$ 、Fe-Co の平均磁気モーメントをTbFe2中のFe磁気モーメント ($-1.8\mu_B$)程度^{39,40)}と考えて磁気モーメントの角度を見 積もった。結果をTable IIIに示す。垂直磁気異方性を有す る場合はTbの磁気モーメントとFe-Coの平均磁気モー メントはほぼ平行で、磁化はTb磁気モーメントが支配的 である。これはTb4f電子のランダム磁気異方性よりTb の4f電子と3d遷移金属の3d電子の交換相互作用(Tb4f -TM3d交換相互作用)が支配的であることを示す。一 方、等方的磁気特性の場合はTbの磁気モーメントが比較

Table III Tb 4f magnetic moments, μ_{Tb4f} , and average magnetic moments of Fe and Co, μ_{3d} , are estimated in TbFeCo amorphous films with perpendicular magnetic anisotropy (PMA) and isotropic magnetization (IM). Cant angles of μ_{Tb4f} and μ_{3d} with respect to applied magnetic field are shown as θ_{Tb4f} and θ_{3d} , respectively

	magnetic	moment	cant angle	
	$\mu_{ m Tb4f}/\mu_{ m B}$	$\mu_{ m 3d}/\mu_{ m B}$	$\theta_{\rm Tb4f}/{\rm degree}$	$\theta_{\rm 3d}/{\rm degree}$
PMA film.	$1.7 \hspace{0.2cm} \pm 0.17$	-0.47 ± 0.05	79 ± 1	$-75\pm\!2$
IM film	-0.76 ± 0.08	0.95 ± 0.10	-85 ± 1	58 ± 4

的ランダムに分布し、磁化は Fe-Coの磁気モーメントが 支配的となる。これは Tb4f-TM3d 交換相互作用より Tb4f 電子のランダム磁気異方性が支配的であることを示 す。この傾向は X 線磁気円二色性による測定結果³⁹⁻⁴¹⁾と 一致する。これらのことから、ランダム磁気異方性と Tb4f-TM3d 交換相互作用の関係が TbFeCo アモルファス 合金の垂直磁気異方性の起源の重要な因子の1つである ことがわかる。

10. まとめ

以上をまとめると、①磁気薄膜のスピンに依存した運動 量密度の異方性の観測に成功した②金属人工格子の垂直磁 気異方性は 3d 遷移金属の 3d 電子の異方性の寄与に起因 する③ TbFeCo アモルファス合金の垂直磁気異方性は電 子構造の直接的異方性よりも磁気構造が間接的に寄与す る、ことがわかった。

本稿で述べた方法のほかに斜入射配置で厚い基板に成膜 した200 nm 程度の薄膜の磁気コンプトンプロファイルの 測定にも成功している⁴⁴⁾。このように,磁性薄膜の磁気 コンプトンプロファイル測定技術はほぼ確立したと考えて いる。これは10年前には想像していなかったことであり, KEK-PF-AR, SPring-8 などの放射光施設の高度化に負 うところが大きい。

謝辞

本稿で紹介した結果は伊藤文武名誉教授,尾池弘美技術 職員,高野勝昌博士,大田実氏,村山栄司氏(群馬大学工 学研究科),劉小晰准教授,森迫昭光教授(信州大学工学 部),櫻井吉晴博士,伊藤真義博士(JASRI/SPring-8), 小泉昭久博士,永尾俊博氏(兵庫県立大学理学部),河田 洋教授,安達弘通博士(高エネルギー加速器研究機構物質 構造科学研究所)との共同研究です。

本研究は高エネルギー加速器研究機構共同利用課題 (2003G163, 2005G116), SPring-8パワーユーザー課題 (2003B2980-PU, 2004A3890-PU, 2005A5890-PU and 2005B7003-PU), 群馬大学ATEC研究プロジェクト (Project 2003-Project2006) によるものです。

参考文献

- 第47回総合科学技術会議資料 中村(東北大通研) http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu47/siryo3.pdf
- P. F. Carcia, A. D. Meinhaldt and A. Suna: Appl. Phys. Lett. 47, 178 (1989).
- F. J. A. den Broeder, D. Kuiper, H. C. Donkersloot and W. Hoving: Appl. Phys. A 49, 507 (1989).
- F. J. A. den Broeder, D. Kuiper, A. P. van de Mosselaer and W. Hoving: Phys. Rev. Lett. 60, 2769 (1988).
- 5) P. F. Carcia: J. Appl. Phys. 63, 5066 (1988).
- H. Nemoto, H. Nakagawa and Y. Hosoe: IEEE Trans. Mag. 39, 2714 (2003).
- 7) H. Nemoto and Y. Hosoe: J. Appl. Phys. 97, 10J109 (2005).
- T. Katayama, Y. Suzuki, Y. Nishihara, T. Sugimoto and M. Hashimoto: J. Appl. Phys. 69, 5658 (1991).
- 9) H. Saga, H. Nemoto, H. Sukeda and M. Takahashi: J. Magn. Soc. Jpn. 23, 225 (1999).
- H. Katayama, S. Sawamura, Y. Ogimoto, J. Nakajima, K. Kojima and K. Ohta: J. Magn. Soc. Jpn. 23, 233 (1999).
- 11) 例えば「量子力学Ⅰ, Ⅱ」小出昭一郎著, 裳華房.
- 12) 例えば「固体物理学入門 上・下」キッテル著,字野良清, 津谷昇,森田章,山下次郎訳,丸善.
- 13) N. Sakai and N. Ôno: Phys. Rev. Lett. 37, 351 (1976).
- 14) "X-ray Compton Scattering" eds. M. J. Cooper, P. E. Mijnarends, N. Shiotani, N. Sakai and A. Bansil: Oxford University Press, New York, 2004.
- 15) M. Blume: J. Appl. Phys. 57, 3615 (1985).
- 16) N. Sakai: J. Appl. Crystallogr. 29, 81 (1996).
- 17) A. Koizumi, S. Miyaki, Y. Kakutani, H. Koizumi, N. Hiraoka, K. Makoshi, N. Sakai, K. Hirota and Y. Murakami: Phys. Rev. Lett. 86, 5589 (2001).
- 18) 坂井信彦,田中良和:応用物理 61,226 (1992).
- F. Biggs, L. B. Mendelsohn and J. B. Mann: At. Data, Nucl. Tables 16, 201 (1975).
 M. Ota, H. Sakurai, F. Itoh, M. Itou and Y. Sakurai: I. Phys.
- 20) M. Ota, H. Sakurai, F. Itoh, M. Itou and Y. Sakurai: J. Phys. Chem. Solids. 65, 2065 (2004).
- H. Sakurai, M. Ota, F. Itoh, M. Itou, Y. Sakurai and A. Koizumi: Appl. Phys. Lett. 88, 062507 (2006)
- 22) Y. Kakutani, Y. Kubo, A. Koizumi, N. Sakai, B. L. Ahuja and B. K. Sharma: J. Phys. Soc. Japan 72, 599 (2003).
- 23) Y. Kubo and S. Asano: Phys. Rev. B 42, 4431 (1990).
- 24) M. J. Cooper, S. P. Collins, D. N. Timms, A. Brahmia, P. P. Kane, R. S. Holt and D. Laundy: Nature 333, 151 (1988).
- 25) 「磁気工学の基礎 I」太田恵造著,共立出版
- 26) K. Kyuno, J.-G. Ha and R, Yamamoto: Phys. Rev. B 54, 1092 (1996).
- 27) K. Kyuno, J.-G. Ha, R. Yamamoto and S. Asano: J. Phys. Condens. Matter 8, 3297 (1996).
- 28) K. Kyuno, J.-G. Ha, R. Yamamoto and Asano: Solid State Communications 98, 327 (1996).
- 29) H. Sakurai, F. Itoh, Y. Okabe, H. Oike and H. Hashimoto: J. Magn. Magn. Mater. **198–199**, 662 (1999).
- 30) D. Weller, Y. Wu, J. Stohr, M. G. Samant, B. D. Hermsmeier and C. Chappert: Phys. Rev. B 49, 12888 (1994).
- 31) H. Sakurai, F. Itoh, M. Ota, H. Oike, K. Takano, X. Liu and H. Kawata: J. Magn. Magn. Mater. 286, 410 (2005).
- 32) H. Mühlbauer, CH. Müller and G. Dumpich: J. Magn. Magn. Mater. 192, 423 (1999).
- S. Chikazumi: Physics of Magnetism, John Wiley and Sons, New York, 1964.
- M. R. Bozorth: Ferromagnetism, N. J. D. Van Nostrand Co., Ltd., Prinston, 1951.
- 35) H. Sakurai, E. Murayama, M. Ota, K. Takano, F. Itoh, X. Liu, H. Kawata, H. Adachi, Y. Sakurai, M. Itou and A.

Koizumi: J. Magn. Magn. Mater. 310, 2710 (2007).

- 36) X. Liu, A. Morisako, H. Sakurai, Y. Sakurai, M. Itou and A. Koizumi: J. Magn. Magn. Mater. 310, 1744 (2007).
- 37) H. Sakurai, M. Ota, X. Liu, A. Morisako, Y. Sakurai, M. Itou, T. Nagao and A. Koizumi: J. Appl. Phys. **102**, 013902 (2007).
- 38) M. Murakami and M. Birukawa: J. Appl. Phys. 95, 7327 (2004).
- 39) C. Bordel, S. Pizzini, J. Vogel, K. Mackay, J. Voiron, R. M. Galera, A. Fontaine, P. Auric, J. B. Goedkoop and N. B. Brookes: Phys. Rev. B56, 8149 (1997).
- 40) C. Bordel, S. Pizzini, J. C. Toussaint, B. Kervorkian and J. Voiron: J. Magn. Magn. Mater. 193, 170 (1999).
- A. Agui, M. Mizumaki, T. Asahi, J. Sayama, K. Matsumoto, T. Morikawa, T. Nakatani, T. Matsushita, T. Osaka and Y. Miura: Trans. Magn. Soc. Japan 4, 326 (2004).
- 42) V. G. Harris and T. Pokhil: Phys. Rev. Lett. 87, 067207 (2001).
- 43) J. M. D. Coey: J. Appl. Phys. 49, 1646 (1978).
- 44) H. Sakurai, F. Itoh, M. Ota, K. Takano, X. Liu, H. Oike and H. Kawata: J. Phys. Chem. Solids **65**, 2083 (2004).



● 著 者 紹 介 ●

櫻井 浩 群馬大学大学院工学研究科 生産システム工学専攻・准教授 E-mail: sakuraih@el.gunma-u.ac.jp 専門:磁気工学

[略歴]

1988年東北大学工学部材料物性学科卒 業。1993年群馬大学工学研究科電子情 報工学専攻博士後期課程修了,博士(工 学)。群馬大学工学部電気電子工学科助 手,群馬大学工学部電気電子工学科助教 授を経て,2007年4月から現職。

Anisotropy of magnetic Compton profiles in perpendicular magnetic anisotropy films

Hiroshi SAKURAI

Department of Production Science and Technology, Gunma University 1–5–1 Tenjin-cho, Kiryu, Gunma 376–8515, Japan

Abstract We have succeeded to observe anisotropy of spin dependent momentum distribution of perpendicular magnetic anisotropy (PMA) thin films by means of magnetic Compton scattering. These experiments suggest that PMA of metallic multilayers constituted by noble metals and 3d transition metals come from anisotropy of 3d electrons of the 3d transition metals. However, a TbFeCo amorphous alloy shows an isotropic electronic structure and the PMA of the TbFeCo amorphous alloy reflects the magnetic structure indirectly.